Upgrade of beam diagnosis system for RIBF

Tamaki Watanabe^{1,A)}, Masaki Fujimaki^{A)}, Nobuhisa Fukunishi^{A)}, Masayuki Kase^{A)}, Kazunari Yamada^{A)},

Naruhiko Sakamoto^{A)}, Kenji Suda^{A)}, Misaki Komiyama^{A)}, Takeshi Nakamura^{A)B)}, Ryo Koyama^{A)B)},

Yasuteru Kotaka^{A)B)}, Osamu Kamigaito^{A)} and Yasushige Yano^{A)}

^{A)} RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based Science

2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198

^{B)} Sumitomo Heavy Industries Accelerator Service Ltd.

1-17-6 Osaki, Shinagawa, Tokyo, 141-0032

Abstract (英語)

Beam diagnosis system has been upgraded to measure current, orbit of heavy-ion beams for the RIKEN RI beam factory (RIBF). New Faraday cups have been installed into the transport lines of the RIKEN heavy-ion linac (RILAC), the RIKEN ring cyclotron (RRC), the fixed-frequency ring cyclotron (fRC), the intermediate-stage ring cyclotron (IRC) and the superconducting ring cyclotron (SRC) to measure the current of accelerated heavy-ion beams. The design of the new Faraday cups, the improvement of a differential probe and the experimental results obtained during the commissioning of the RIBF using the heavy-ion beams are described in this report.

RIBFにおけるビーム診断系の高度化

1. はじめに

理研のRIBFでは、1台の線形加速器と4台のサイ クロトロンによって、重イオンのカスケード加速を 行っている[1][2]。それぞれの加速器で加速される ビームの電流値、加速器内のビーム軌道、位相を正 確に診断する^[3]ことは、ビームの質を向上させ、ま た加速器を効率良く運転するために、極めて重要で ある。今回、ビーム診断系の高度化を図るために、 特にファラデーカップとビーム軌道検出用ラジアル プローブの開発・改良を行った。ファラデーカップ の電流測定精度を上げるためには、ビームがカップ に当たることによって放出される二次電子を、いか に抑制できるかが重要な問題となってくる。設計に あたって、サプレッサー電極によって形成される電 場を、三次元で計算を行った。その結果、従来型と は違う、サプレッサーとカップを分離した構造を採 用し、全50台のファラデーカップのうち約半数弱を 更新した。また、中間段サイクロトロンfRCとIRC のラジアルプローブにおいては、Flat-top Cavityから 加速軌道上に漏洩する電磁場によって生ずる障害を、 貫通コンデンサーによる多段フィルターより改善し、 ビーム軌道が正確に得られるようになった。

2. ファラデーカップの改良

従来型のファラデーカップのヘッド部を図1に示す。 このファラデーカップは、高エネルギー大強度ビー ムに使用することを想定し、約10 kWの冷却能力を 持つように設計をした。ビームによる発熱を緩和す るために、カップを斜めにカットした構造を採用し



図1:従来型のファラデーカップのヘッド部

た。しかし、カップの構造が非対称なため、カップ とサプレッサー電極までの距離が短い程、ビ発生す る二次電子の立体角が大きくなるため、二次電子が 逃げ出やすくなる。そのため、ビームを調節する時、 ビームをカップの浅い個所に移動する程、逃げ出る 二次電子が多くなり、その分だけビーム電流を多く 読み、ビーム調節を難しくしていることが判明した。



¹ E-mail: <u>wtamaki@riken.jp</u>



図3: RI-BFビーム輸送系の新型ファラデー カップ(M11:fRC-IR間)

その対策として、ネオジム系永久磁石(表面最大磁場:約0.6 T)を取り付けることによって、発生する 二次電子をトラップさせ、改良を試みた。0.1 Tの磁場中では、1 keVのエネルギーを持つ電子のラー マー半径は、約1.1 mmと計算される。永久磁石のト ラップの効果により、一時的に正確に電流値が読め るようになった。しかし、しばらく使用すると、 ビームによる発熱により、温度が磁石のキュリー温 度を超えてしまい、磁石が減磁してしまった。根本



図3:計算コードMAFIAによる、サプレッサーに1 kVの電圧をかけた際の電場計算。(a)カップの断面 (X-Y面)における電位の等高プロット(b)中心 領域(X=0, Z=0)におけるY軸上の電位。

表1:従米型と新型のサイスと立体角の印

	カップの	サプレッ	カップの	立体角
	深さ(mm)	サーの厚	直径(mm)	(sr)
		さ(mm)		
従来型	26	3	46	0.783
新型	62	61	62	0.715

的に二次電子の問題を解決するため、新しいファラ デーカップの設計を行った。新しいファラデーカッ プの詳細を図2に、また、一例として、RI-BFの ビーム輸送系にインストールされた写真(M11: fRC-IR間)を図3に示す。この設計にあたっては、 計算コードMAFIAを使い、サプレッサーの電場計 算を行った。サプレッサーに1 kVの電圧をかけた際 の、カップの断面計(X-Y面)で見た電位の等高プ ロットを図3(a)に示し、さらに中心領域(X=0, Z=0)における、Y軸上の電位を図4(b)に示す。こ の計算により、サプレッサーの電場が最小になって しまう軸中心上でも、加えた電圧の8割の電位を形 成できるという結果が得られた。従来型と新型の ファラデーカップのサイズとカップ中心からの立体 角の比較を表1に示す。この新型ファラデーカップ は、サプレッサー電極は固定されており、SHV フィードスルーにより電圧が供給される。一方、



図4:(a)サプレッサーに印加する電圧に対す る、電流値の測定結果。(b)(a)の結果を、サ チュレーションをした時の電流値でノーマライズ した結果。

カップは常時引き出されているが、電流測定の際に、 圧空によって真空チェンバー内に挿入される。カッ プはBNCフィードスルーによって、電流信号が取り 出され、120 dBのダイナミックレンジを持つログア ンプによって増幅され、その値がEPICSシステム^[4] によって読みだされる。

上記のサプレッサーの効果を調べるために、ウラ ンビームを加速したコミッショニングにおいて試験 を行った。サプレッサーにかける負の電圧を変化さ せ、ある電圧以上で電流の値が変化しないサチュ レーションの状態を、二次電子が十分サプレスされ た状態と考える。各加速器で加速されたウランのエ ネルギーと価数の違うビームを使用して測定した結 果を図4(a)に示す。この結果、ビームエネルギー 114 MeV/u²³⁸U⁸⁶⁺までのビームは、約70 V以上のサ プレッサー電圧で、全てのファラデーカップにおい て、サチュレーション状態に入っていることを確認 した。測定前には、ファラデーカップ近傍に設置さ れたプロファイルモニターを用いて、ビームが±10 mm以内に入る様に調節した。さらに、サプレッ サーに正の電圧を加えていって、逆に二次電子を積 極的に加速し、どのくらい二次電子が発生している かを調べた。その結果を、同じく図4(a)に示す。 測定する箇所で電流値が違うので、比較し易くする ために、サチュレーションをした時の電流値でノー マライズした結果を図(b)に示す。これより、RRC で加速され、なおかつチャージストリッパーを通過 したあとのエネルギー11 MeV/u²³⁸U⁷²⁺のビームを使 用したファラデーカップ(FC D14)では、ビーム電 流の約10培近くの二次電子が発生していることが 解った。ビームのエネルギーが低く、価数が高いほ ど、二次電子の発生が多い傾向があることが解った。 今後、この現象について細かい解析を進める。

3. ラジアルプローブの改善

fRCとIRCのラジアルプローブを改良し、加速軌 道全域にわたってビーム電流を検出できるように改 善できた。

これまではFlat-top Cavityからの漏洩電場により、 ビーム電流が読めなくなる領域があった。fRCを例 に説明する。fRCでは取り出し軌道周辺で影響が大 きく、加速器調整に影響を与えていた。図5にその 様子を示す。図中右側の乱れた波形部分が取り出し



図5. 改良前の状況



図6. 改良後の状況

軌道周辺に相当する領域である。このような欠陥を 改善するために、以下の改良を実施した。

- ・ 電極近傍の配線に小容量貫通コンデンサーに よるフィルター1を挿入
- フィルター1は信号伝送路インピーダンスに
 整合させ反射波による影響を小さくしている
- ・ 信号伝送路を2重シールド同軸線に変更
- 伝送路途中に大容量貫通コンデンサーによる フィルター2を挿入
- プローブ電極支持軸の先端付近が加速器本体 に接地するようコンタクタトフィンガー取り 付け

以上の改良により図6の様に改善された。フィル ターの構成を図7に示す。



4. ラジアルプローブ(ソフト)の改善

ラジアルプローブのソフトウエアーとして、メ ニューに以下の改善を行うことによって、操作性が 大幅に改善された。

- 縦軸、横軸のスケール変換
- ・ 任意の領域を選択し詳しく表示
- ・ グラフホールド機能の追加
- データの保存機能の拡充
- ・ カーソル機能の追加

参考文献

- [1] 上垣外 修一他,"理研RIビームファクトリーの現状", *in this proceedings*.
- [2] 福西 暢尚他, "RIビームファクトリーにおけるウラン ビーム加速試験", *in this proceedings*.
- [3] 小山 亮他, "RIビームファクトリー におけるロック インアンプを用いたビーム位相及び加速RF監視シス テム", in this proceedings.
- [4] M. Kobayashi-Komiyama et al.: RIKEN Accel. Rep. 37, 277 (2004).